$$e = 1 + 4pa_{3\pi} + \frac{2p e^2 d^2 n}{kT} \frac{1}{1 + iwt}, \ t = \frac{1}{2n} e^{\frac{U}{kT}},$$

где d – расстояние между двумя положениями равновесия, n – концентрация ионов, n – частота колебания около положения равновесия, U – высота потенциального барьера. Моделирование дает, что для того, чтобы при  $n \approx 10^{21}$  см<sup>-3</sup> экспериментальная кривая e(T) совпадала с теоретической, необходимо положить, что ионы металлов колеблются со сверхнизкими частотами ~ $10^5$ Гц, при движении перескакивают на расстояние ~  $3,7*10^{-8}$ м, энергия активации (например, для Na) составляет U = 0,15 эВ. Это говорит о том, что простая модель с ионно-миграционной поляризацией в данном случае не применима.

Более реальные результаты можно получить, если дополнительно учесть зернистость и пористость цеолитовой керамики. В этом случае диэлектрические свойства следует рассматривать как свойства гетерогенной системы с использованием формулы Лихтнекера [2]. Для смеси из **N** компонентов имеем:

$$\mathbf{e'} = \prod_{i=1}^{N} \left[ (\mathbf{e'_i})^2 + (\mathbf{e''_i})^2 \right]^{0.5x_i} \cos \left[ \sum_{i=1}^{N} x_i \operatorname{arctg} \left( \frac{\mathbf{e''_i}}{\mathbf{e'_i}} \right) \right]$$

Тангенс диэлектрических потерь будет определяться как

$$\operatorname{tg} \boldsymbol{d} = \frac{\boldsymbol{e''}}{\boldsymbol{e'}} = \operatorname{tg} \left[ \sum_{i=1}^{N} x_i \operatorname{arctg} \left( \frac{\boldsymbol{e''}_i}{\boldsymbol{e'}_i} \right) \right]$$

где,  $\varepsilon'$  и  $\varepsilon''$  – компоненты комплексной диэлектрической проницаемости,  $x_i$  – объем занимаемый ка-

ждой компонентой, 
$$\sum_{i=1}^{N} \mathcal{X}_i = 1$$
 .

В этом случае для простой модели двухкомпонентной системы цеолит (85%) – воздушные поры (15%) получается хорошее совпадение теоретической и экспериментальной кривых e(T) для обычных параметров ионных кристаллов:  $n \approx 10^{21}$  см<sup>-3</sup>,  $\omega \approx 10^{13}$  Гц,  $\delta \approx 2*10^{-10}$ м и энергия активации составляет U = 0,24эВ. для образца №1, U = 0,288 эВ для образца №3.



Рисунок 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости на частоте 10<sup>6</sup> Гц

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1]. Гельман Е. М., Соробина И. Д. Ускоренные химические методы определения породообразующих элементов: Химические методы. Инструкция № 138-Х / Под председ. Г. В. Остроумова. – М.: ВИМС, 1976. – 58 с.

[2]. Барышников С.В., Баранов А.Ф., Медовой А.И. Труды III международной конференции "Кристаллы: рост, свойства, реальная структура, применение", Т.2 – Александров: ВНИИСИМС, 1997.– С.402-405.

## ПОТЕРИ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ С СУБМИКРОННЫМ N-P-ПЕРЕХОДОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЕМ НЕРАВНОВЕСНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАРЯДА

Богатов Н.М., Матвеякин М.П., Родоманов Р.Р. Кубанский государственный университет

Технология изготовления полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) непрерывно совершенствуется, так что потери энергии в объеме наиболее эффективных структур сведены к минимуму. Это достигается использованием исходного полупроводникового материала, очищенного от посторонних примесей и дефектов, уменьшением толщины сильно легированных слоев, контролем физических и геометрических параметров неоднородных областей. Одной из тенденций усовершенствования ФЭП является уменьшение глубины p<sup>+</sup>-n-перехода до значений w<sub>n</sub>≤0,1 мкм. В этих условиях возрастает доля потерь энергии, обусловленных процессами на поверхности И границах раздела диэлектрикполупроводник, полупроводник-полупроводник, металл-полупроводник.

Целью работы является исследование влияния неравновесного поверхностного заряда на величину внутреннего электрического потенциального барьера и ток короткого замыкания кремниевых фотоэлектрических структур с субмикронным эмиттером.

Проанализирована структура области пространственного заряда (ОПЗ) субмикронного несимметричного p-n-перехода (рис. 1). В этом случае размер части ОПЗ в p-слое совпадает с толщиной эмиттера  $w_p$ , а в n-слое –  $x_n$  много меньше толщины базы. Распределение объемного заряда зависит от плотности заряда Q<sub>s</sub> на поверхностных состояниях внешней гра-

ницы эмиттера, концентрации акцепторов в эмиттере  $N_A$ , и доноров в базе  $N_D$ .



Рисунок 1. Условная схема распределения заряда Q в несимметричным p-n переходе

На рис. 2 и рис. 3 изображены рассчитанные зависимости, соответственно, величины электрического потенциального барьера  $\phi$  и  $x_n$  от плотности поверхностного заряда  $Q_s$  при следующих параметрах p-n-перехода:  $w_p=1,5\cdot10^{-7}$  м,  $N_A=10^{25}$  м<sup>-3</sup>,  $N_D=10^{21}$  м<sup>-3</sup>. Увеличение  $Q_s$  вследствие захвата фотогенерирован-

ных носителей заряда обусловливает уменьшение модуля электрического потенциального барьера p-n-перехода и размера ОПЗ в n-слое. Влияние этого эффекта на потери тока короткого замыкания планарных кремниевых фотоэлектрических структур исследовано теоретически и экспериментально.



Рисунок 2. Зависимость величины потенциального барьера от плотности поверхностного заряда



Рисунок 3. Зависимость размера ОПЗ в n-слое от плотности поверхностного заряда

В неравновесном случае  $Q_s=Q_{s0}+\Delta Q_s$ . Индекс "0" обозначает равновесное значение соответствующей величины. Неравновесная плотность поверхностного заряда  $\Delta Q_s$  индуцирует падение напряжения на p-n-переходе

$$V_{s} = \frac{(w_{p} + x_{n0})}{ee_{0}} \Delta Q_{s} - \frac{1}{2} \frac{\Delta Q_{s}^{2}}{ee_{0} q N_{D}},$$
 (1)

где  $\varepsilon$  – диэлектрическая проницаемость,  $\varepsilon_0$  – электрическая постоянная, q – элементарный заряд. В

правой части выражения (1) второе слагаемое меньше первого для допустимых значений физических величин.

Полное падение напряжения на p-n-переходе в режиме электрической нагрузки

 $V=U+V_s+IR_s$ , (2)

где U – напряжение на контактах прибора, I – электрический ток,  $R_s$  – сосредоточенное последовательное сопротивление. В режиме короткого замыкания (U=0) ток  $I_{ks}$  вычисляется по формуле

$$I_{\kappa_{3}} = I_{ph} - I_{0} \left( \exp\left\{\frac{q(V_{s} + I_{\kappa_{3}}R_{s})}{kT}\right\} - 1\right) - I_{r} \left( \exp\left\{\frac{q(V_{s} + I_{\kappa_{3}}R_{s})}{akT}\right\} - 1\right) - \frac{V_{s} + I_{\kappa_{3}}R_{s}}{R_{sh}}, \quad (3)$$

где I<sub>ph</sub> – фототок, I<sub>0</sub> – диффузионный ток насыщения, k – постоянная Больцмана, T – температура, I<sub>r</sub> – рекомбинационный ток насыщения, *a* – коэффициент неидеальности p-n-перехода, R<sub>sh</sub> – шунтирующее сопротивление [1]. В стационарном случае

$$\Delta Q_s \approx \frac{q N_{sf} I_{ph}}{I_{ph} + b}, \qquad (4)$$

где  $N_{sf}$  – плотность состояний в окрестности уровня Ферми в энергетическом зазоре шириной  ${\sim}kT,$  коэффициент  $\beta$  характеризует скорость захвата неравновесных носителей заряда.

Из (1–4) следует, что  $I_{\kappa_3}$  нелинейно зависит от  $I_{ph}$ , причем разность этих величин определяется величиной неравновесного поверхностного заряда. Эта зависимость продемонстрирована на рис. 3. Концентрация излучения X определялась с помощью эталонного

ФЭП с глубоким p-n-переходом, у которого  $I_{\kappa 3} \approx I_{ph0} X$ . Исследовались кремниевые ФЭП со структурой p<sup>+</sup>-n-n<sup>+</sup> или n<sup>+</sup>-p-p<sup>+</sup> типа, глубиной p-n-перехода  $w_p \approx 0,15$  мкм, текстурированной поверхностью, на которую наносилось пассивирующее просветляющее покрытие SiO<sub>2</sub>. Экспериментальная зависимость  $I_{\kappa 3}(X)$  для исследуемого ФЭП аппроксимировалась по формуле (3). Для этого параметры  $I_{ph}=I_{ph0}X$ ,  $I_0$ ,  $I_r$ , a,  $R_s$ ,  $R_{sh}$  определялись из данных измерений темновых и световых вольтамперных характеристик [2]. Оценка спектральной плотности поверхностных состояний в окрестности уровня Ферми, полученная в результате аппроксимации, дает  $N_{sfe}=N_{sf}/kT\sim 4\cdot 10^{15}$  эВ<sup>-1</sup>м<sup>-2</sup>.

29

Таким образом, обнаружен дополнительный механизм потерь тока короткого замыкания, заключающийся в увеличении тока инжекции за счет падения напряжения на p-n-переходе, индуцированного накоплением неравновесного поверхностного заряда, в структурах с субмикронным эмиттером. Для исследуемых ФЭП эти потери лежат в пределах от 9% до 19,7%.



Рисунок 3. Зависимость тока короткого замыкания от концентрации излучения X для исследуемого ФЭП (1) и эталонного ФЭП (2)

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фаренбрух А., Бьюб Р. Солнечные элементы: Теория и эксперимент. М.: Энергоатомиздат. 1987. -280 с.

2. Богатов Н.М., Матвеякин М.П., Родоманов Р.Р., Яковенко Н.А. // Автометрия. 2003. Т. 39. № 6. С. 68.

## ВОЗБУЖДЕНИЕ Ar I ПРИ ПАРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ АТОМОВ АРГОНА В ОСНОВНОМ СОСТОЯНИИ Курсков С.Ю., Хахаев А.Д.

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Данная работа посвящена изучению возбуждения Ar I при взаимодействии атомов аргона низких энергий в условиях однократных столкновений. В ней представлены результаты экспериментального исследования зависимости сечений возбуждения спектральных линий Ar I для переходов между Ar(3p<sup>5</sup>4s)и Ar(3p<sup>5</sup>np)-состояниями (3≤n≤6) от главного квантового числа при энергии соударения 450 эВ (с.ц.м.).

Измерения сечений возбуждения при взаимодействии пучка быстрых атомов с газовой мишенью выполнены методами оптической спектроскопии с помощью автоматизированной установки на базе IBMсовместимого персонального компьютера и программно-управляемой системы КАМАК. Формирование пучка быстрых атомов осуществлялось путем симметричной резонансной перезарядки ионов на собственном газе в каналах вытягивающего электрода газоразрядного источника ионов. Давление газамишени в камере столкновений было равно  $4.5 \cdot 10^{-1}$  Па, давление остаточного газа не превышало  $3 \cdot 10^{-4}$  Па. Излучение возбужденных частиц регистрировалось под углом 90<sup>0</sup> к атомному пучку, поэтому возбужденные частицы пучка и мишени не различались. Поляризация излучения не учитывалась.

Впервые получены сечения возбуждения спектральных линий Ar I для  $4s'[1/2]_{1}^{0} - np'[1/2]_{0}$ ,  $4s[3/2]_{1}^{0} - np[1/2]_{0}$ ,  $4s[3/2]_{2}^{0} - np[5/2]_{3}$ ,  $4s'[1/2]_{0}^{0} - np'[3/2]_{1}$ ,  $4s[3/2]_{2}^{0} - np[5/2]_{2}$ ,  $4s'[1/2]_{0}^{0} - np'[1/2]_{1}$ ,  $4s[3/2]_{2}^{0} - np[3/2]_{1}$  и  $4s[3/2]_{2}^{0} - np[3/2]_{2}$  -переходов ( $4 \le n \le 6$ ) при указанной энергии столкновения. Эти данные позволили установить вид зависимости сечений возбуждения от главного квантового числа. Зави-